

Comparative ellipsometric and ion beam analytical studies on ion beam crystallized silicon implanted with Zn and Pb ions

Lohner, Tivador; Angelov, Christo; **Mikli, Valdek** Thin solid films 2008 / 22, p. 8009-8012

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609008003660>

О возможностях аппроксимации эллипса

Talvik, I. XXVI студенческая научно-техническая конференция вузов Молдавской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик, 21-23 апреля 1982 года : тезисы докладов. Часть 2, Химия и технология, механика, строительство 1982 / с. 281

https://www.ester.ee/record=b5165223*est